

Judul:

Vacuum technology, thin films and sputtering: an introduction

Pengarang/Penulis:

Stuart, R.V., author

Subjek:

Vacuum technology; Thin films; Cathode sputtering(plating process)

Nomor Panggil:

621.55 STU v

Penerbitan:

Academic Press

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)